

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員総会議事次第

日時 2021年1月28日（木） 13:10 ～ 13:30
場所 Web会議

- 議題
1. 委員動静・幹事構成について
 2. 2020年度予算収支報告と2021年度予算案について
 3. 2020年度,2021年度の研究会企画について
 4. 2022年度ハワイシンポジウムについて
 5. 2021年度のDRIPについて
 6. その他

- 配付資料
1. 第9期委員名簿
 2. 令和2年度決算、令和3年度予算報告

今年度予定

【定例研究会】

- (1) 第170回「高精度結晶加工のための加工および計測技術」2021年1月28日
世話人：*佐野、閻
- (2) 第171回「Si-IGBT」2021年2月26日
世話人：*西澤、佐俣、泉妻
- (3) 第172回「先端デバイスに開発に貢献する分析・評価技術」2021年6月以降
世話人：*泉妻、佐俣、小椋
- (4) 第173回 未定

【国際シンポジウム】

第8回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム(<http://gakushin145.kir.jp/hawaii2020/>)
The 8th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials (2022)
実行委員長 末岡 浩治

【国際シンポジウム】

19th International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XIX)

開催日：2021年11月7日-11日

場所：横浜

実行委員会委員長：土田秀一，関口隆史

【国内シンポジウム】

パワーデバイス Si 研究会

実行委員会委員長：石川由加里

第145委員会のHP：<https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>